

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОН та НАН УКРАЇНИ
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

**Физическая
инженерия
поверхности**

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична
інженерія
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical
surface
engineering**

Том 3, № 1–2, січень – червень 2005

ХАРКІВ

Засновники:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки України
та Національної академії наук України
Концерн “Центр нових технологій” Харківський фізико-технічний інститут

Видається за рішеннями:

Вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
протокол № 6 від 24 червня 2005 р.

Вченої ради Наукового фізико-технологічного центру
протокол № 5 від 23 червня 2005 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04 р.

© Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2004

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2004

© Концерн “Центр нових технологій” Харківський фізико-технічний інститут, 2004

<i>Фареник В.И.</i> Получение и транспортировка ионных пучков малых и средних энергий	4
<i>Порицкий П.В.</i> Влияние примесей меди на свойства плазмы и контракцию дугового разряда высокого давления	30
<i>Береснев В.М., Швец О.М., Беляева Т.Н.</i> Особенности ввода высокочастотной энергии в поток металлической плазмы	37
<i>Андреев А.А., Шулаев В.М.</i> Субмикрослоистые композиционные покрытия TiN-CrN на стали	40
<i>Стрельницкий В.Е., Аксенов И.И., Васильев В.В., Воеводин А.А., Джонс Дж. Г., Забински Дж. С.</i> Исследование пленок алмазоподобного углерода и соединений углерода с азотом, синтезированных вакуумно-дуговым методом	43
<i>Хороших В.М.</i> Потoki плазмы стационарной дуги низкого давления	54
<i>Лисовский В., Бут Ж.-П., Ландри К., Дуэ Д., Ренар Г., Касань В.</i> Определение величины ВЧ напряжения на потенциальном электроде в сложных технологических газоразрядных установках	70
<i>Береснев В.М.</i> Вакуумно-дуговые многослойные покрытия	79
<i>Хороших В.М.</i> Плазма вакуумной дуги в присутствии газа в разрядном промежутке	82
<i>Приходько В.И., Турбин П.В.</i> Кинетика частиц поверхности во внешнем флуктуирующем поле	97
<i>Белоус В.А., Хороших В.М.</i> Динамика плазмы вакуумной дуги в магнитном поле и системы формирования плазменных потоков ...	108
<i>Азаренков Н.А., Орлов В.Д., Слипченко Н.И., Удовицкий В.Г., Фареник В.И.</i> Нанонауки и нанотехнологии: современные достижения, перспективы, проблемы и задачи развития	127
<i>Приходько Н.И.</i> До питання про роль та значення інтелектуального капіталу у процесі відродження України	147
<i>Правила оформления статей</i>	151
<i>Правила оформлення статей</i>	152
<i>Information for authors</i>	153